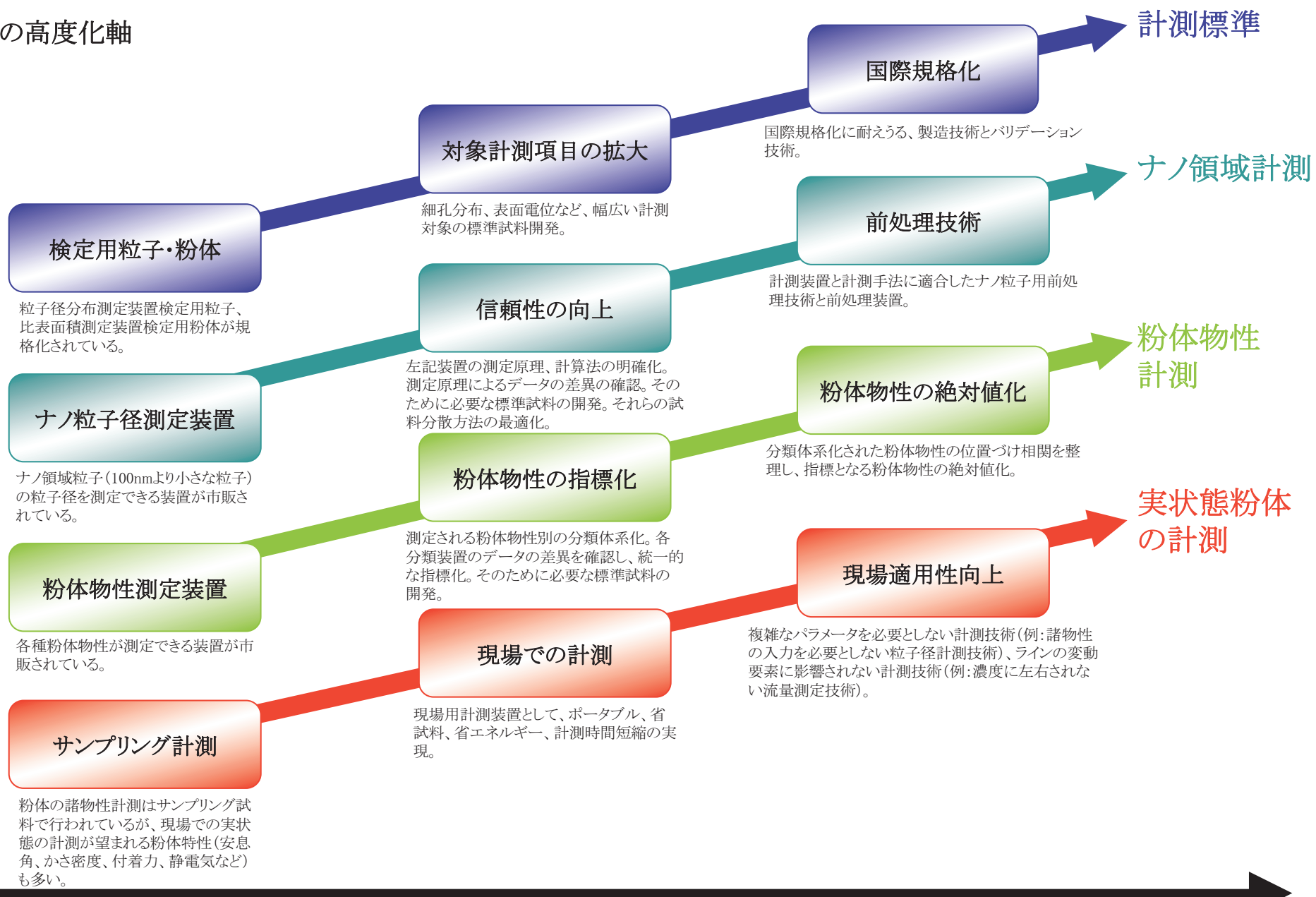


8. 計装測定分科会

技術の高度化軸



検定用粒子・粉体

粒子径分布測定装置検定用粒子、比表面積測定装置検定用粉体が規格化されている。

ナノ粒子径測定装置

ナノ領域粒子(100nmより小さな粒子)の粒子径を測定できる装置が市販されている。

粉体物性測定装置

各種粉体物性が測定できる装置が市販されている。

サンプリング計測

粉体の諸物性計測はサンプリング試料で行われているが、現場での実状態の計測が望まれる粉体特性(安息角、かさ密度、付着力、静電気など)も多い。

対象計測項目の拡大

細孔分布、表面電位など、幅広い計測対象の標準試料開発。

信頼性の向上

左記装置の測定原理、計算法の明確化。測定原理によるデータの差異の確認。そのために必要な標準試料の開発。それらの試料分散方法の最適化。

粉体物性の指標化

測定される粉体物性別の分類体系化。各分類装置のデータの差異を確認し、統一的な指標化。そのために必要な標準試料の開発。

現場での計測

現場用計測装置として、ポータブル、省試料、省エネルギー、計測時間短縮の実現。

国際規格化

国際規格化に耐えうる、製造技術とバリデーション技術。

前処理技術

計測装置と計測手法に適合したナノ粒子用前処理技術と前処理装置。

粉体物性の絶対値化

分類体系化された粉体物性の位置づけ相関を整理し、指標となる粉体物性の絶対値化。

現場適用性向上

複雑なパラメータを必要としない計測技術(例: 諸物性の入力が必要としない粒子径計測技術)、ラインの変動要素に影響されない計測技術(例: 濃度に左右されない流量測定技術)。

計測標準

ナノ領域計測

粉体物性計測

実状態粉体の計測

現在

近未来

将来(夢)

時間軸